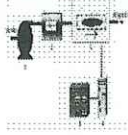
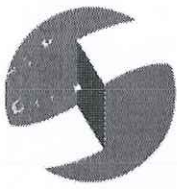
	Tình trạng đơn:			
	Tên Sáng chế:	Hệ thống xử lý plasma và phương pháp xử lý nước uống bằng hệ thống xử lý plasma		
	Số đơn:	1-2013-03072	Ngày nộp đơn:	01.10.2013
	Công bố:	1-2013-03072	Ngày Công bố:	26.05.2014
	Số bằng:	VN1-0019727-000	Ngày cấp bằng:	01.08.2018
	IPC Classes:	C02F 1/50, C02F 1/72		
	IPC Classes:	Trần Ngọc Đảm		
	IPC Classes:	<ul style="list-style-type: none"> Sáng chế đề xuất hệ thống xử lý plasma bao gồm nguồn nước (1), bộ lọc thô (2), bồn điều áp (3), van tiết lưu Q2 được đặt sau bồn điều áp (3) để điều chỉnh lưu lượng và áp suất vào buồng xử lý plasma (4), mạch điều khiển dòng plasma (5), bộ điều khiển lập trình tự động (6) và bồn chứa nước sạch (7), bồn chứa nước tràn về (8). Nguồn nước (1), bộ lọc thô (2), buồng điều áp (3), buồng xử lý plasma (4), bồn chứa nước sạch (7) và bồn chứa nước tràn về (8) được nối với nhau bằng các ống dẫn. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp xử lý nước uống bằng hệ thống xử lý plasma, nước sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn nước uống đóng chai. 		

	Tình trạng đơn:			
	Tên Sáng chế:	Thiết bị tiệt trùng không khí bằng plasma lạnh ở áp suất khí quyển		
	Số đơn:	2-2016-00181	Ngày nộp đơn:	01.11.2013
	Công bố:	2-2016-00181	Ngày Công bố:	25.04.2014
	Số bằng:	VN2-0001401-000	Ngày cấp bằng:	11.07.2016
	IPC Classes:	A61L 2/00, A61L 2/14, A61L 9/00		
	IPC Classes:	Trần Ngọc Đảm		
	IPC Classes:	<ul style="list-style-type: none"> Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị tiệt trùng không khí bằng plasma lạnh ở áp suất khí quyển. Thiết bị này bao gồm : máy bơm khí (1), bộ lọc khí và van tiết lưu (2), buồng plasma (3), mạch điều khiển dòng plasma (4) và bộ điều khiển lập trình tự động (5). 		



Ngày in : 15.08.2022

Truy vấn : Từ khóa:Không có điều kiện

Kết quả : 3 records found

	Tình trạng đơn:			
	Tên Sáng chế:	Nguồn tạo plasma lạnh ở áp suất khí quyển		
	Số đơn:	1-2014-02680	Ngày nộp đơn:	11.08.2014
	Công bố:	1-2014-02680	Ngày Công bố:	25.08.2015
	Số bằng:	VN1-0020389-000	Ngày cấp bằng:	25.12.2018
	IPC Classes:	H02M 7/00, C23C 4/00, C02F 1/42		
	IPC Classes:	Trần Ngọc Đàm		
	IPC Classes:	<ul style="list-style-type: none">Sáng chế đề cập đến nguồn tạo plasma bao gồm biến áp (1) biến đổi trị số điện áp dòng điện xoay chiều đầu vào điều chỉnh được, dòng điện xoay chiều sau khi được biến đổi trị số sẽ qua bộ chuyển đổi dòng điện (2) để chuyển đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều, bộ điều khiển tần số (3) tiếp nhận dòng điện một chiều từ bộ chuyển đổi dòng điện (2) và tần số dạng xung được tạo ra từ bộ biến tần (4) để cho ra điện áp xung cao tần, bộ biến áp cao tần (5) tiếp nhận điện áp xung cao tần và khuếch đại điện áp này, ngõ ra của biến áp cao tần (5) được nối với hai điện cực của buồng plasma (6) tạo ra plasma.		